

Portador De Wafers Circulares De 6 Polegadas Em Ptfе Resistente A Ácidos E Álcalis Cesto De Limpeza De Semicondutores Personalizável

Número do item: PL-CP55



introdução

Portadores de wafers de 6 polegadas em PTFE de alta pureza, projetados para processamento úmido crítico de semicondutores. Projetados para extrema resistência química e estabilidade térmica, esses cestos de flores personalizáveis garantem limpeza uniforme e proteção do substrato em ambientes hostis de imersão ácida e alcalina durante toda a produção.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Limpeza RCA de Semicondutores	Imersão de wafers em soluções SC-1 e SC-2 para remover contaminantes orgânicos e iônicos.	Resistência total a agentes oxidantes e bases de alta temperatura.
Processos de Gravação Úmida	Remoção seletiva de camadas de material usando ácido fluorídrico (HF) ou ácido fosfórico.	O posicionamento preciso do substrato garante profundidade de gravação uniforme em todo o wafer.
Remoção de Fotolitografia	Remoção de camadas de fotoresiste usando solventes orgânicos agressivos ou soluções piranha.	O material não inchará ou se degradará quando exposto a solventes agressivos.
Texturização de Células Solares	Limpeza de alto volume e texturização de superfície de wafers de silício para eficiência aprimorada.	O design durável suporta os rigores do rendimento químico em escala industrial.
Enxágue Pós-CMP	Remoção de partículas de lama e produtos químicos após o polimento químico-mecânico.	Superfícies ultrassuaves impedem o reanexo de partículas e facilitam o enxágue fácil.
Preparação para Análise de Traços	Limpeza de componentes de laboratório de alta pureza em ácido nítrico ou clorídrico concentrado.	Elimina riscos de contaminação cruzada para análise elementar de ultra-traços.
Fabricação de MEMS	Manuseio especializado de substratos para a produção de microeletromecânicos sistemas.	Dimensões de fendas personalizáveis acomodam espessuras de substratos não padronizadas.

Parâmetro	Especificação para PL-CP55
Identificação do Produto	Portador de Wafers Circular PL-CP55 (Cesto de Flores)
Composição do Material	Politetrafluoretileno (PTFE) Virgem de Alta Pureza
Compatibilidade de Tamanho de Wafer	6 Polegadas (150mm) Padrão (Tamanhos personalizados disponíveis)
Configuração	Cesto Circular com Fendas / Design de Flor Perfurada
Contagem de Fendas / Capacidade	Personalizável (Opções padrão: 10, 25 ou 50 fendas)
Temperatura de Operação	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Resistência Química	pH 0-14 (Resistência universal a ácidos/álcalis/solventes)
Largura da Fenda / Passo	Totalmente Personalizável por especificação do usuário

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Parâmetro	Especificação para PL-CP55	
Tipo de Alça	Alça fixa integrada ou alça oscilante de PTFe destacável (Personalizável)	
Acabamento Superficial	Usinado em CNC Suave ($Ra \leq 0,8\mu m$ típico)	
Método de Fabricação	100% Usinado em CNC de Precisão (Produto Personalizado)	
Dimensões	Projetadas sob medida para se ajustar a dimensões específicas de bancada úmida ou tanque	